PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-225830

(43) Date of publication of application: 11.11.1985

(51)Int.CI.

G02F 1/133 **B41J** 3/21 1/133 G02F G03G 15/04 HO4N 1/23

(21)Application number: 59-083286

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

25.04.1984

(72)Inventor: INOUE YUJI

KOMATA TOMOJI **OSADA YOSHIYUKI INOUE YUTAKA**

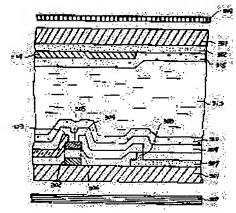
YAMAKAWA TADASHI SATOMURA HIROSHI

(54) IMAGE FORMING DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase number of time division without decreasing an image forming speed by disposing microshutter group which sandwiches a liquid crystal between a substrate provided with plural segment electrodes and a substrate provided with a common electrode into the optical path for exposure.

CONSTITUTION: An FET formed on the substrate 301 is provided with a gate electrode 302 connected to a gate line, a source electrode 303 connected to a data line and a drain electrode 304 for taking out a data signal. The electrode 304 is connected to the segment electrodes 307 forming a shutter part. The resistance of an a-Si film 305 decreases and the electrodes 303 and 304 are made conducting when a scanning signal is impressed to the electrode 302. The liquid crystal element is formed by sandwiching the N-P type liquid crystal between the substrate 301 and the counter substrate 311 in the orientation state and a transparent common electrode 312, a light shielding film 314 and an orientation control film 315 are provided on the substrate 311. The liquid crystal shutter array consisting of such element is disposed in the optical path for exposure via orthogonal polarizing plates 319, 320, by which the number of time division is increased without decreasing the image forming speed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-225830

G 02 F 1/133 1 2 9 7348-2H B 41 J 3/21 8004-2C	@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		②公開	昭和60年(198	85)11月11日
G 03 G 15/04 1 1 6 6691-2H	B 41 J 3/21 G 02 F 1/133 G 03 G 15/04	1 1 8 1 1 6	8004-2C D-8205-2H 6691-2H	審査請求	未請求	発明の数 4	(全22頁)

②特 願 昭59-83286

❷出 願 昭59(1984)4月25日

裕 긂 砂発 明 者 上 俣 智 砂発 明 者 小 芳 坴 砂発 明 者 長 田 砂発 明 者 井 上 兽 砂発 明 者 Ш Œ Щ 博 70発 明 者 村 キャノン株式会社 ⑪出 願 人 ②代 理 人 弁理士 丸島 饒一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

UE AR A

1 . 発明の名称

画像形成装置及びその斟動法

2 . 特許請求の範囲

(1) 露光光額及び、該露光光額の露光光路中 の光線を光遮断状態と光透過状態の何れか一方 に組御するマイクロシャッタ群を備えたプリン タヘッドと、敵プリンタヘッドよりの光信婦を 像保持部材に照射するようになした画像形成装 難において、前記マイクロシロャッタ群が複数 の行及び列に沿ってマトリクス状に配置され、 敲マイクロシャッタ 群が顔膜トランジスタのド レインと接続された1つのシャッタ間を形成す るセグメント電板を入設けた基板とコモン電板を 設けた基板との間に殺菌を挟持した構造を有し ており、前記務膜トランジスタのゲート線に走 在信号を印加し、この走在信号と同期させてデ ータ銀に画像情報に応じた電気信号を印加する 手段を備えたことを特徴とする頭像形成装置。 (2) 前記複膜トランジスタが対向する基板間 に被品を封止するために設けた封止部材より外側に配置されている特許請求の範囲第1項記載 の両像形成装置。

(3) 前記移膜トランジスタとドレインに接続 したセグメント地樹が同一基板上に形成されて いる特許請求の範囲第2項記載の随像形成装 野。

(4) 削記薄限トランジスタが外部回路基板の 上に形成されている特許請求の範囲第2項記載 の画像形成装置。

(5) 前記 静 限 トランジスタのチャネル部に おけるゲート 絶縁 膜 に印加される 世 発強度 を 5 × 1 0⁵ V / c m 以下とした特許 請求の 範囲 第 1 項記載の 両 像 形 成 装置。

(6) 前記機膜トランジスタが半線体としてアモルファスシリコンを備えている特許請求の範囲第1項記載の顧飯形成装置。

(7) 弱光光想及び、該露光光想の露光光路中の光線を光遮断状態と光透過状態の何れか一方に翻測するマイクロシャック群を備えたプリ

ンタヘッドと、酸プリンタヘッドよりの光信号 を像保持材に照射するようになした態像形成装 置の駆動法において、前記マイクロシャッタ群 が複数の行及び列に沿ってマトリクス状に配置 され、酸マイクロシャッタ群が確膜トランジス タのドレインと接続された1つのシャッタ部を 形成オスセグメント電板とコモン電板の間に流 晶を挟持した構造を有しており、前配複数行の うち選択された行の書き込み期間中に、この行 に対応するセグメント電極群とコモン電極の間 の液晶に光遮断状態を形成する電圧を印加する 第1の期間と缺行に対応するセグメント電極群 のうち選択されたセグメン電極とコモン電板の 間の液晶に光透過状態を形成する電圧を印加す る第2の期間を有していることを特徴とする画 像形成装置の駆動法。

(8) 前記第1の期間の政前で光額をベルス点 灯又は光量を増大させる特許請求の範囲第7項 記載の画像形成装置の駆動法。

(9) 前記第1の期間の時間と第2の期間の時

時をデータ線に印加する第1の期間と被第1の期間の後に後段トランジスタのゲート線に走査信号を印加し、この走査信号を印加した行に対応するセグメント電機群のうち選択されたセグメント電機と接続するデータ線に減走査信号と同期させて光透過状態を形成する電気信号を印加する第2の期間を有することを特徴とする順像形成装置の駆動法。

 間の和をもつパルス巾の電気信号を糠膜トランジスタのゲート銀に順次印加する特許請求の範 囲第7項記載の画像形成装置の駆動法。

(10)前記第1の期間と第2の期間で鬱脹トランジスタのゲート線に印加する電気信号を交互に印加する特許請求の範囲第7項記載の画像形成装置の駆動法。

させて 画像 情報に応じた 世 気 信号をデータ級に印加することにより、 複数 のマイクロシャッタ 群のうち選択されたマイクロシャッタを光透器状態となすことにより形成した。 特部材に所定時間照射した後に 故光信号を前配像時の被晶に印加した 電圧極性と 逆極性電圧を 被晶に印加する 期間を 有することを特徴とする 画像形成装置の 駆動法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、n(行)×m(列)側のマイクロシャッタ群をマトリクス配置した液晶シャッタアレイ及び光額を有するプリンタヘッドを輸えた機像形成装置及びその駆動法に関する。

これまで、n個の走査電板と四個の信号電板をマトリクス状に構成し、多数の態素やシャッタ側口部を容量型負荷案子である液晶で形成した液晶表示案子や液晶シャッタアレイは、よく知られている。この液晶 煮子の駆動法 としては、起充電極群に顧次周期的にアドレス信号を選択印加し、信号電極群には所定の情報倡导

をアドレス信号と同期させて並列的に選択印加する時分割駆動が採用されている。この駆動法では、ド記の式(1)で水す様に時分割数が増すにつれてVon(オン信号)/Voff(オフ信号)
が1に近くなり両長を構成する被品を子の開閉効率が恐くなる。このため、特に液品シャッタアレイの場合では、十分なS/N比をもつ光信号を与えることができず、これを電子写した時には良好な時像を形成できない欠点を有している。

(武中、 1 / N ; デューティ比、 1 / a ; バイアス比、 V o ; 印知電圧)

に対し、画像形成速度を遅くすることなく時分割数を高め、このため安価で高性能な液晶シャッタアレイを備えた画像形成装置及びその駆動法を提供することにある。

本発明のかかる目的は、露光光源及び、該強 光光源の露光光路中の光線を光遮断状態と光透 過状態の何れか一方に制御するマイクロシャッ タ群を備えたプリンタヘッドと、該プリンタヘ ッドよりの光信号を像保持部材に照射するよう にした画像形成装置において、前記マイクロシ ャッタ群が複数の行及び列に沿ってマトリクス 状に配置され、旗マイクロシャッタ群が薄膜ト ランジスタのドレインと接続された1つのシャ 福勉 ッタ部を形成するセグメント電板を放けた基板 とコモン電極を設けた基板との間に液晶を挟持 した構造を有しており、前記穂膜トランジスタ のゲート線に走査信号を印加し、この走査信号 と同期させてデータ級に画像情報に応じた電気 信号を印加する手段を鍛えた画像形成装置によ って達成される。

すなわち、水発明の目的は画像形成速度(ブロセスピード)を遅くすることなく、時分割数を増やなし、且つ駆動用IC数を減少させるにはICの低耐圧化をはかる必要があり、このためコストダウンがはかれないという従来の問題なを解消し、さらに従来では画像形成速度を遅くしても時分割数はたかだか4程度どあったの

以下、本発明を図面に従って説明する。

本発明者らの実験検討によれば、直流のゲー ト電圧Vgocを単位時間(hr)当りで印加し た時の関係電圧Vthの変動分をAVthとした 時、 第1回に示される様にゲート絶縁膜の電累 強度Egが低レベルのゲート電圧Vgl(約4 0 V ~ 6 0 V) を越えると、 △ V thが指数関数 的に増大している。このことは、ゲート電圧 VgがVglを越えると急激にライフタイムの 短縮が生じることを表わしている。ところが、 ゲート絶線膜に印加される電界強度を 5 × 10⁵ V / c m 以下とした時、 T F T の ラ イ フ タイムを短縮せずにゲート電圧Vgを高くする ことができ、従って十分なS/N比、好ましく は5以上のS/N比、好ましくは5以上のS/ N比をもつ光信号を発生できる点にも別な特徴 を有している。

TFTは、Vg-Vth>Vs (Vg;ゲート電圧、... Vth; 関値電圧、Vs;デー×電圧)の非飽和領域で 用いられ、この領域でのVx (t) / Vs (Vx (t); 出力電圧)は、充電開始前(t=0)の時、下記式 (2)によって安わされる。

式中、 m、 T (TFTの充電時定数) 及び L (液 晶残留電圧電位) はそれぞれ下記式 (3) , (4) 及び (5) で表わされる。

$$m = \frac{V s}{2 (V g h - V t h) - V s} \dots (3)$$

$$T = \frac{m}{K V s} C \dots (4)$$

$$L = \frac{1 - V_{X}(0) / V s}{1 - m V_{X}(0) / V s} \dots (5)$$

又、 式 中 C は 負荷 容量 を、 V g h は プ ラ ス 傳 の ゲ ー ト 電圧、 t は ゲ ー ト オ ン 時間 を 示 し、 又 K は 下 式 (4) ´ に よっ て 示 さ れ る。

式(2)に従えば、出力電力Vx(t)を高くするには、データ電圧Vsを高めることによって達成されるが、Vg-Vth>Vsの関係式からゲート電圧Vgを固めることが必要となる。

しかし、ゲート電圧Vgを高めることはTFTのライフタイムを短縮させることになり、このため実用的な液晶シャッタアレイ、特にTFTのライフタイムを短縮させることなく20ボルト以上の出力電圧Vx(t)を得ることができるTFTマトリクスの時分割駆動法が求められている。

そこで、本発明者らは前述の点について鋭意 検討を重ねたところ、TFTのライフタイムを 短縮させることなく、高圧(例えば30ポルト 以上、特に40ポルト~60ポルト)のゲート 電圧Vgを印加することができるTFTマトリ クスの時分割駆動法を見い出すことができた。

すなわち、本発明はゲートオン時 T F T のゲート 絶縁膜における電異強度を 5 × 1 0 5 V

€ 0: 真空誘導率 (F/cm)

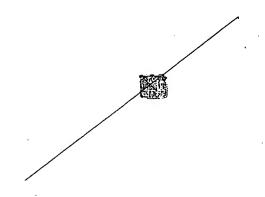
ε s: 絶縁膜比誘導率

ル: 易動度 (cm²/Vsec)

dins: 絶縁層膜厚 (cm)

L:チャンネル長(c m)

W:チャンネル巾(cm)



/ c m以下となる様にゲート絶縁 膜厚を設定することによってTFTのライフタイムを維持することができる。本発明の好まして具体例ではゲート絶縁 膜を水素原子をドーピングした600人のチッ化シリコン(比誘電率6.60で形成し、半導体膜を2000人のアモルファスシリコン(比誘電率12)で形成した時、ゲート電圧Vgを40ポルト~60ポルトで印加しても、TFTのライフタイムの短縮は見られなかった。

第3 図(A)は、本発明で用いる被出来子の断面図で、基板301(ガラス、ブラスチック上になか)のATFTが形成されている態様をポート線いる。TFTは、走査信号を印加するがート線に接続されたソースで極302、情報信号を出力信号として取り出する。とこのデータ信号を出力信号として取り出するとしている。といく、ドレイン電機302に走査信号を印加まるといる。ゲート電機302に走査信号を印加まるとアモルファスに模303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とドレイン電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルフェス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアモルファス電機303とアロールでは1000

ドフィルムが使用される。

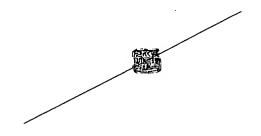
本発明で用いる被晶素子は、前述のTFTを マトリクス状に配置したTFTマトリクス基板 と対向基板 3 1 1 の間にネマチック 液晶 3 1 3 (NP型液晶)が第1図で示した配向状態で挟持さ れている。対向基板311の上には、コモン値 横312となるITOフィルムが形成され、さ らに前述した液晶 - シャッタアレイの場合では マイクロシャッタ部を形成するために閉口部以 外を遮光するためのクロム/アルミニウム積層 **蒸着フィルムよりなる遮光膜314が対向電板** 3 1 2 の上に積粉されている。これらコモン電 横3 1 2 と遮光膜3 1 4 の上に配向制御膜3 1 5 がポリイミドなどによって形成されている。 · 第、3 図(B)は、本発明で用いる液晶シャッ タアレイを模式的に表わした断菌図である。太 発明の被晶シャッタアレイは、TFT部316 が破晶素子317の基板301と同一基板30 1 ′の上で、且つ液晶素子317の外部に形成 されている。特に、TFT316は液晶楽子3

0 4 が接続状態となる。

本 免明 で 用いる TFTは、ゲート 電極 3 0 2 と ア モルファスンリコンフィルム 3 0 5 の間に快まれたゲート 絶 緑 だ 3 0 6 として、 水 条原子をドープした 6 0 0 0 人 チッ化ンリコン (比 誘電 6 . 6) が 使 用 される。このチッ化シリコン イルムは、ゲート 電極 3 0 2 と なる クロムノアルミニウム 枝 居 燕 若 フィルムと セ グメントで 核 3 0 7 と なる I TO(Inding Tin Oxide)の 燕 着 フィルム が 所 定 形状 で パターニング された 茶 板 3 0 1 の 上 に グロー 放 電下 で 全 面 に 亘って形 成 される。又、 ドレイン 電極 3 0 4 と セグメント 電極 3 0 7 は、 チッ化シリコンフィルムに設けた スルーホール 3 0 8 を介して 接続される。

この様なTFTと、電極をもつ基板301の上に、さらに水素原子をドープしたチッ化シリコンフィルムで形成した絶縁膜309と配向制御膜3103010としては、例えば1000人のポリイミ

1 7 の基板 3 0 1 と コモン電板 3 1 2 を設けた対向 落板 3 1 1 間 の 液晶 3 1 3 を 封止 する ために形成した エポキシ 系接 若剤 などによる 封止 部材 3 1 8 の外側に配置されていることが 好ましい。 又TFT 3 1 6 は 液晶素子 3 1 7 の基板 3 0 1 と は 別に I C 回路 など の外 部 回路 落板 (図示せず) の上に 設けることもできる。 図中の第 3 図(A)と同一符合のものは、同一部材を表わしている。 又、 図中 3 1 9 と 3 2 0 は クロスニコルの 偏光子で、 3 1 2 は クロム・アルミニウム などによる TFT 3 1 6 の半導体膜 3 0 5 に対する 遮光膜を表わしている。



特開昭60-225830(6)

第4図(A)は、水発明の液晶シャッタアレ イで用いるTFTマトリクス提板の回路で、第 4 凶 (B) はその平面図を表わしている。 T F Tマトリクスは、アレイ状にTFT4011. 4012,4013,4014,4015,4 0 1 6 , 4 0 1 7 , 4 0 1 8 , (TFT: 401) が配置された構造を有している。 TF T401は、走旅信号をゲート電機に印加す るゲート線(4021、4022、4023, 4 0 2 4) 群 4 0 2 、 竹 報 (データ) 信 5 を ソース電機に印加するデータ線(4031。 4 0 3 2 , ……) 群 4 0 3 とデータ線 4 0 3 か らのデータ信号が出力信号として印加されるド レイン電極(4051,4052,4053, 4054)と接続したマイクロシャッタのセグ メント電機(4041,4042,4043, 4044,4045,4046,4047,4 048,……)群404がそれぞれ接続されて

木実施例では、データ線 4 0 3 1 に T F T

分割で情報の書き込みが行なわれるため、 間走作方向 4 0 5 へ常に移動している像保持部材である感光ドラム (図示せず)上での情報書き込みが 1 フレーム中で直線となって行こなうためである。

第4図(C)は、第4図(B)のA-A・断面図を表わしている。図中、桔板409の上に形成したゲート線4021数には絶縁膜407が一面に亘って覆われているが、交差するゲート線4022,4023と4024をまたい水で、コンタクトペール406を楽してそれぞれが導電膜410によって接続されている。

これらの交差して配置したゲート級上には、 絶縁 版 4 0 8 が 設けられ、その上にデータ線 4 0 3 1 が配置されている。

第5回は、液晶シャッタアレイを用いて光信 号を「燃光ドラムに与えるための概略構成を示し ている。但し、帯電器、現像器、クリーニング などは省略している。53は、前述の如き液晶 シャッタアレイ、51は燃光ドラム(アモルフ 4 0 1 1 . 4 0 1 2 . 4 0 1 3 と 4 0 1 4 が共通接続され、データ線 4 0 3 2 に T F T 4 0 1 5 . 4 0 1 6 . 4 0 1 7 と 4 0 1 8 が共通接続されている。一方、ゲート線 4 0 2 1 に T F T 4 0 1 1 . 4 0 1 1 . 4 0 1 5 が共通接続されている。同様に他のゲート線についても図示する如くTFTと共通接続されている。本実施例では 4 次時分割駆動方式について明らかにしたものであるが、本発明では 2 次 . 3 次又は 5 次あるいはそれ以上の多次時分割駆動方式とすることができる。

この様なTFTマトリクス構造では、ゲート 電板(及びゲート電板からゲート線へ引き出す 引き出しゲート電板)とドレイン電板に接続されているセグメントと電板との間で重なり部がな く、従ってこの重なり部により発生する不要な 容量COを生じることがない。

又、本実施例ではマイクロシャックのセグメント 電極群 4 0 4 が駆次チドリ状に配列されているが、これは、マイクロシャック部が順次時

次に、第4図に示す配列状態のシャッタ開口部(Win、Win、win)で4次時分割駆動を行なう場合のドットパターンを形成する例を説明

第6回は、液晶シャッタアレイに印加する影

動信号のタイムチャートの具体例を表わしてい る。ここで、G1~G4はゲート線4021, 4022.4023と4024に印加する114圧 披型で、電位V2が印加された時TFTがオン 状態となりソース電板とドレイン電板の間が導 通状態となる。一方、電位が-Viで印加され た時にはTFTはオフ状態となり、ソース電極 とドレイン電極の間がカットオフ状態となり、 電気的に遮断される。従って、ゲート電板の印 加電圧がV2の時、TFTのドレイン電板に接 セグ×ント 続された製売電極の電位がTFTのソース電機 データ に接続された工力線に印加した電位に変化し、 次にゲート電機の印加電圧を-V1にすると、 データ セグメント その 直前 で 入力線 に 印 加 し た 電 位 が 支 式 框 極 に 保持される。

Cは、コモン電極に印加する電圧被形で、本 実施例では常に単位Oに保持されている。SI はソース電極(データ電板)に印加する電圧被 形で、閉口部W1、W2、…をオンかオフの何 れかに設定するに従って、電位を0かVとする

世圧が印加される.

次に、閉口部W1に注目してシャッタ開閉の 動作制御について説明する。

時間T11において、マイクロシャッタ部W1 のセグメント電極4041と接続されているT FT4011のゲート線4021 (G1) に接 統されたゲート電橋の電位がV2となり、TF T 4 0 1 1 はオン状態となる。時間で11とで12 (T·11+T12=T11)ではデータ電極4031 (S1) の電位は V であるので、マイクロシャ ッタ部W-1のセグメント電機4041の電位も ほぼ∨となる。従って、この時マイクロシャッ タ部W 1 はオフ状態となっている。続く時間で 13 ではゲート線 4 0 2 1 (G 1) に接続された ゲート電板の電位が一V1となるので、たとえ データ電極 4 0 3 1 (S₁) に電圧が印加され ても、マイクロシャッタ部W 1 のセグメント 電極は電位 V を保持することができる。 T 13 = T12+T13+T14で、T12はゲート線4022 (G2) に、T13はゲート線4023 (G3)

に、T14はゲート級4024(G4)にそれぞ れV2の電圧を印加する期間である。従って T 11 + T 12 + T 13 + T 14 が 1 フレーム 期間とな る。統くフレーム期間の時間 T 21 で再びゲート 電板(G 1)の電位がV2となってTFT40 1 1 がオン状態となる。この時間 T 21 の前半の 時間で21でデータ電板(S 1)の電位がVとな り、マイクロシャッタ部W1のセグメント電板 に電圧Vが付与され、続く後半の時間で22(T FTのオン状態が保持されている)でデータ電 極(S1)の電位が0となるので、マイクロシ ャッタ 簡W 1のセグメント 電極の電位が 0 に変 化し、続く時間で23(= T22+T23+T24)の 間、重位のが保持される。従ってマイクロシャ ッタ部Wlに相当する液晶に印加される電圧が 0となっているため、第2図で説明した様にシ ヤッタのオン状態(光透過状態)が1フレーム 期間に形成される。

第6図中のIW1-CIで、マイクロシャッ タ部W1のセグメント電極とコモン電機間、す なわち液晶に印加される電圧被型を時系列に従 って明らかにしている。これに従えば時間で12 + で 13 + で 21 で | W 1 - C | は電位差 V となっ ていて、次のフレーム期間のうち時間で22+ T 23 で | W 1 - C | は電位差 0 となっている。 この時のマイクロシャッタW1の時系列におけ る透過率の変化を第6図中のTェ1で明らかに している。この図示によれば、時間で12+で13 + で 21 の 期間においては、マイクロシャッタ部 W1の透過率はTrd(暗レベル)であり、時 間で22+で23+で31の期間においてはマイクロ シャッタ部W1の透過率はTェℓ(明レベル) まで徐々に上昇し、次のフレーム期間ので31で IW1-CIがVとなる場合では図示する如く Trdに復帰する。

又、図中のIW2-C|はマイクロシャッタ W2の電極とコモン電機間の時系列における電 位益を示し、Tr2はその時の透過率の変化を 表わしている。

第7図は、光スポット像のドット d 1 1 2 d 2 1 を作製する際のシーケンスを示している。 各ドットの内、 第1列のドット (d 1 1 1 1 d 2 1 1 d 3 1 1 d 4 1 1 1 1 d 2 1 d 2 1

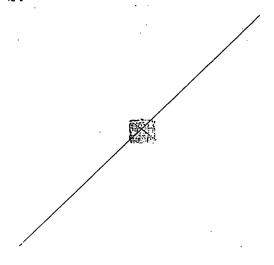
本発明の時分割駆動法では、例えば前記の如き4次時分割駆動によりマイクロシャッタ部を動作すると、1フレーム期間中でマイクロシャッタ部のオン状態(光透過状態)あるいはオフ状態(光遮断状態)を保持することができる。

従って、この強制的なシャッタ閉時間をデータ書き込みの直前又は直後に設定することにより、データ書き込みの際のシャッタ閉時及びシャッタ閉時の領状態において、常に安定したるの過光量が得られ、常に安定したコントラストのプリント画像を得ることが可能となる。各ドッ

すなわち、暗レベルのドットを形成 する 時には 1 行分のドット生成時間(で 12 + で 13人で 21)に 直って透過率を暗レベル(Trd)とし、又 明レベルのドットを形成する時には 1 行分のドット生成時間(で 22 + で 23 + で 31)に 亘って透過率を 明レベル(Tr ℓ)とする ことができる。この時の明暗比、すなわち S / N 比は第 6 図中の 商人A と B との 上に相当したものとなり、 単 に マクアレイで 使用されて い ハ 比を 大幅に向上することができる。

又、本実施例では第6図に示す様にゲート線を走査する初期期間において、この走査信号を問期させて入力する情報信号には電圧 V が付加されている。これは、前述の第2図に示す方面での被晶に印加される電圧を0とすると、透過では第8図に示す様に時間に対して被型状に変異なける。この現象は一般に光のパウンシック銀でよって、第8図によれば1つのマイクロシャック銀でオン状態が3でに互っ

本発明者らの実験によれば、8 mmの被晶に20 Vの電圧を印加する場合、時間で11は 約0.24 msec、従って0.2 msec以上であればよく、又時間で12は数十μsecであれば充分で、時間で11+で12は約0.3 msecが料明した。又、開口が分に変度(プロセススピード)を50 mm/secとすると、第1行のドット形成時間(で11+で12+で13)は、1.25 msecの1/4時間 即ち 0.3 1 2 5 m s e c に設定して 4 次時分割 駆動を実現できることが判明した。 さらに、 この際、明暗比が 6.5 にまで向上し、明レベル の光母が従来の単純マトリクス駆動方式の場合 と比較して 2 倍以上となっていることも判明し



そこで、第9図に示す様にシャッタ関ロ部を 強制的に閉じるために必要な時間(本発明者ら の実験では、T 11 = 0 . 2 4 m s e c 、 液晶の 厚み8μm、駆動40Vとした)でゲート線G 1, G 2, G 3, … G n (n; 時分割数) に顧 次ゲートオンパルスを印加し、これと何期させ てデータ電板に電圧Vを印加する。従って、順 次マイクロシャッタ部がオフ状態となり、 続く フレーム期間でデータ電板に選択信号(電圧 0 か V) を印加する。 すなわち、第1走査期間 t 1 でマイクロシャッタ部に対応する液晶に電圧 V(コモン電板の電板の電位をOとする)を印 加することによってマイクロシャッタ部の全て がオフ状態となり、この第1走齐期間しょはり フレッシュ期間に相当している。続く第2走査 期間も2でデータ何号に従った電圧をデータ電 様にゲート線の走査信号(で1)と同期させて 印加することによって、所定のマイクロシャッ タ部をオン状態又はオフ状態に設定する。この 第2走査期間 t 2 はデータ 出き込み期間に相当

第9図は、本発明の時分割駆動法の別の具体例を表わしている。第9図に示す具体例は、さらに時分消数を増大させた場合に適した駆動法である。

すなわち、第 6 図にボナ B 動 例では、 関 口部の 造過率を 明 レ ベル T r l / に 転移させる に 要 する 時間で 11 (1 フレームについ て 述 べる) に ゲート 最低 オン 時間(データ 世橋の 電圧を ドレイン 側 で 得るのに 要 する 最低 時間) T 12 を 加えた時間(T 11 + で 12)の間で ゲート 電極を オン状態としている ため、 時分割数を 多くするには 限度がある。 すなわち、 関口部密度を 1 6 ドット/mmとし、プロセススピードを50mm/secと した 時、時分割数は、下記の式(6)によって示される。

$$n = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s \cdot s \cdot s}}{T_{11} (\frac{m}{s \cdot s \cdot s}) + T_{11} (\frac{m}{s \cdot s \cdot s})} = \frac{m \cdot s \cdot c}{0.2 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c \cdot s} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c}{0.2 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c \cdot s} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s \cdot s} \cdot c}{m \cdot s \cdot c} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s} \cdot c}{m \cdot s} = \frac{1 \cdot 25 \frac{m}{s} \cdot c}{m \cdot s} = \frac{1 \cdot 25$$

している。

第9図に示す具体例では、前述のリフレッシュ期間とデータ書き込み期間を交互に設けて駆動するもので、さらに本例ではこのデータ書き込み期間とリフレッシュ期間の間に任意の電圧印加期間 t 3 が付加されているが、この任意期間 t 3 は 省 略 す る こ と も 可 能 で あ る。この 様 な 駆動 法 を用い た 時 の 時 分割数 1 は 式 (7)によって表わされる。

今、フレーム期間 t 1を 0 . 2 4 m s e c と l . ゲート 最低 オン期間 (走 査 信 号 印 加 期間 で 1)を 5 以 s e c と す ると、時分割数は 4 8 まで 可能と なった。 又、第 9 図中の T r に ゲート線 G 1 と データ 電極 S 1 の 端子を 接 続した T F T で ス イッチング されるシャッタ 部の時 系列における 透過率の 変化を 表わしている (T r 2;明 い ベル、T r d;暗 レ ベル)。

第10図は、もう1つの他の具体例を表わし

ている。前述の第9図に示す駆動例では時間

t 1の間で必ず1つのTFTに対してゲートオ

ンパルスが印加され、オン状態となっている

が、本発明では時分割数 n を比較的少なくし

(第10図に示す例では時分割数 n が 4 となっ

ている)。これによりデータパルス印加時間を
短縮することができる。すなわち、第10図に

示すマイクロシャッタ部 W 1、W 2、W 3と

W 4 (第4図の関ロ部に対応)における透過率

波形に示す様に最初に駆動されるマイクロシャ

タの部 W 1 と最後に駆動される関ロ部 W 4 の駆動時間差を 短縮することができる。

今、ここで光額の点灯被製を第10図のLの様にすると、その時の各開口部におけるオン状態の透過光のエネルギーはW1S、W2N、W3S、W4Sで示す面積となる。この場合、明口部W1、W3、W4はシャッタオン状態であり、そこからの透過光のエネルギーはW1S>W3S>W4Sとなるが、この駆動に関しては前記した様に、データパルス印加時間で2が

短いため、この差はほぼ無視できる。例えば、明ロ部(シャッタ部)密度 1 6 ドット/ шш、 プロカススピード 5 0 mm/ s e c , ゲート 最低オン時間で 1 を 5 μ s e c として 4 次時分割 閣 動 を 行 な う 場合では、データ パルス 印 加 時間で 2 は 2 0 μ s e c と なる。これに対して時間で 3 は 1 m s e c 程度である。従って、この程度の時間差による光エネルギΨ 1 S , ₩ 3 S と ₩ 4 S の 差は、ほとんど無視することができる。

この様に光想を最初のゲートにリストンシュメルス(リフレッシュパルス印加時間 で 4)をする直前で、点灯(あるいは、この時間のみた。 P)とすることにより、そのS/N比はなる。 の場合を見積っても W 4 S/W 2 Nとなる。 今、発光中心被長を650nm程度とした光型の を使用し、 開口部密度 1 6 ドット/ m m 点灯 W 2 を使用し、 開口部密度 1 6 ドット/ m 点灯 W 1 下 1 2 を 2 0 0 μ s e c とすると、 W 1 S / W 2 Nは 1 0 倍以上となる。 又、データパルス印加

時間で2を設定したことによりS/N比(W4S/W2N)が多少低化するが、前配した様にW1SとW4Sとのエネルギー急が小さくなる様に時間で2を設定すればS/N比が大幅に改善され、常に安定した電子写真プリント画像を得ることができる。尚、図中の時間で5は任意期間である。

第11図及び第12図は、本発明の別の態様 を表わす駆動例を示している。

第11図は、時分割数nを8とした時のゲー ポット線に印加する電圧被型とデータ電極に印加す ポッ る電圧被型を明らかにしている。時間では1 画 素形成時間に対応していて、式(8) で計算される。

 $\tau = 1 / V p \cdot N \cdots (8)$

(式中 ,

V p ; プロセススピードmm/sec N·ne (数)

第11図において、TFTのゲート最低オン 時間で 1 とした時、で a ≥ で 1 、で b > で 1 と してで a とで b を交互にして時間を区切り、時間で a は液晶に必ず電界を印加し、関口部をオフ状態とし、透過率の変動を防ぐための電位を開口部電極にリフレッシュ(消去)期間で、時間で b は関口部のオンとオフ状態を制御するための電位をマイクロシャッタ部のセグメント電極に与えるデータ書き込み期間としている。

 され、次のおされ、残りの1番素とする。 といっかが 現りの1番素とする。 といっと はが ート線 G 1 に印かし とった が はない アート線 G 2 にはゲート線 G 1 に印かし とった が はい でった はいからした 変形 とった が 期間 できる。 同 G 7 とりが の ゲート線 G 3 、 G 4 、 G 5 、 G 6 、 G 7 とのが ート線 G 1 に電圧 V 2 が 印かいる。 といる ない はい はい ない かん はい が かん ない の か 作を 説明 する。

マイクロシャッタ部W1に接続されたセグメント電極には、時間で1でゲート線G1の電位がサータ電極には電圧Vが印加される。続くなおたデータ電極には電圧Vが印加される。続くときとなり、TFT12021がカットオフ状態のするために、データ線S1の電位にかかわらずでなり、TFT12021がカットオフ状態のずくなり、TFT12021がカットオフ状態のするために、データ線S1の電位にかかわらずでイクロシャッタ部W1のセグメント電極は電位Vが保持される。このことは、時間で1でイ

cとした時、時分割数nは第9図に示す駆動例の場合で240/78=3であるが、第.13 図に示す駆動例の場合で8次時分割が可能である。

又、 第11 図に示す駆動例は最適な時分割をなしていない場合であり、 時間で d で 常にゲート線 G 1 ~ G 8 の うち、何れか 1 つのゲート線 にゲートオンパルスを印加しておらず、 つまり

クロシャッタ部W1に対応するを被出にマイクロシャッタ部W1に対応となって、マイクロシャッタ部W1のオフ状態が形成される。 統サーク の は で で ート線 G1 は 電 略 レーン は と な な の で で ーク 線 S1 の 電 位 で ーク は に し の 電 位 が で レーン は に し の 電 位 が で し と す る な に の り か ら な に い の ら な に い の ら な に い の ら な に な の と は に 印 加 さ れ 、 続 く り カ 間 田 で は に 印 加 さ れ 、 続 く り カ 期 田 で は な り の と す な が な り 、 TFT12021 が カ ットオ と な な り 、 TFT12021 が カ ットオ に な な た に な る ことに な

この駆動法を用いた際の時分割数 n を最大値のものとした時の例を第13回に示す。例えば、明口部密度を16ドット/mm(16pel)、プロセススピードを50mm/sec、時間でc÷240μsec、時間で 1 ÷ 78 μse

時間でd内でどのゲート線にもオフ電圧が印加されいる時間を生じる。従って、各ゲート線へ接続したバッファ回路へのデータ転送速度を遅くすることができ、この点で回路設定が容易となり、コストダウンの上で有効である。

 50 mm/secとした時で、紙間が1秒間に 亘って液晶シャットアレイを通過することにな 形形の るため、この期間における電圧属性を第14図のとおりすることによって、実質上直流駆動と はなっておらず、このため液晶シャットアレイ の寿命を向上させることができる。

第15図は、前述の液晶シャットアレイを用いた電子写真複写機の1例を示すもので、感光ドラム1501を矢印1502の方向に回転駆動させ、まず帯電器1503により感光ドラム1501を一様に帯電させ、液晶シャッタアレイ1504を駆動させて、背後に配置した光光1505よりの光線を選択的に開閉制御して光光に見る。

この静電搭像は、現像器1506のトナーに ドリ現像され、このトナー現象は転写ガイ茶1 507を通ってきた複写用紙P(転写紙)上に 転写帯電器1508により転写される。画像の

に端光するようになっている。この実施例に於ては端光光報1505が液晶セルの加熱の機能も果しており、燃熱来子1520に接続された液晶温度制御側路1516で液晶冷却用ファン1517を助作させることにより、液晶セルの過熱を助止し、液晶セルを一定温度に維持するようにすることができる。図中1518は反射な、1519はレンズアレー1513を液晶シャック失数へ発育するための部材である。

ところで、従来のTFTを用いていない液晶シャッタアレイは第16図に示す電極構造を有しており、この電機構造では、第17図に示す 駆動被形が印加されていた。

たとえば、被遇の厚みを 8 μ 皿 程度にし、 共通電極に ± 1 0 V の 矩形被を印 加 し、信号 電極には、選択する行のシャッタ部を オン状態 にするときは、その共通電極と同じ電圧被形を 印加 し、シャッタ部をオフ状態にするときは、 O V を印加する。 第 1 7 図において、時間 T 1 は A 1 のみオン、時間 T 2 は A 1 のみオンに

転写を受けた複写用紙Pは分離ベルト装置 1 5 09により感光ドラム1501から順次に分離 され、次いで定着装置1510で画像が定着さ れるようになっている。また、転写後感光ドラ ム1501の表面上に残留したトナーはクリー ニング装置151しにより除去され、前露光装 置1512により感光ドラム1501が除電さ れ、再び次の複写サイクルが可能になるように してある。ところで、第15図に於る液晶 シャッタアレイ1504には前述の第2図に示 す液晶セルを採用している。つまり、露光光觀 1505からの光線を液晶セルを備えた液晶 シャッタアレイ1504、セルフオクレンズな どのレンズアレイ1513を介して感光体15 0 1 の上に結像する際に、図示していない原稿 情報読み取り装置によって得られた画像情報を 含んだディジタル信号により液晶駆動回路 1 5 14を動作させて液晶シャッタアレイ1504 をON-OFFさせることにより、画像情報の パターンを有する光信号を感光体1501の上

この場合、1つのドットは、時間 T 1 および T 2 にわたって形成される。従って、感光ドラムの受ける光量の大きさは、シャッタ部がオンのとき面積 1 2 0 1 (1210a+1210), 明口部オフのとき面積 1 2 0 2 (1202a+1202b) に比例する。

従って、電圧Vを低くすると、明暗比がとれなくなる。

また、時分割数を大きくすると、面積 1 7 0 1 aに比較し、 1 7 0 2 bが大きくなるために 明暗比がとれなくなる。

一方、1mm当り16ドットを形成し、 値像 形成速度を50mm/s(A4サイズの 値像をたて ひりで 何分6~8枚形成する速さ)と625mm かったとき、T1は0.625mm かったとき、T1は0.625mgとなる。このレベルにおける液晶シャックの あっされている。すなわち、T1をさくなるが、すると、 透過率 Teが ぜいために、さほどあい 透過率が 優麗られない。

実際、T1を1.25mgとし、2時分割駆動を行ない、電圧を前述の説明の倍の電圧±20Vとした場合でも照射光波長を550mmにして明暗比が3倍程度になってしまう。

ところが、感光体において明 , 暗に対し、 白 . 黒を対応させる場合、少なくとも明暗比は 必要 5 倍以上Aである。従って、明暗比を 5 倍以上に

以上説明した様に、確膜トランジスタを用いて被品シャッターを駆動することにより、実質 駆動は時分割で行っていながら、シャッター透 過光の被形は直接駆動(時分割しない駆動)と 同等の物を得ることが出来る。

つまり、時分割駆動が可能になることにより、データ電板の本数を低減出米(酶素密度 16 dot/mm, 全長 2 1 0 mmの場合、直接駆動時データ電板本数 = 3 3 6 0 本、8 時分割データ電板数 = 4 2 0 本)、従って、

- (1) 液晶シャッターセルと駆動用ICとの 核就(実装)が容易となり、実装コストの減少がはかれる。
- (2) I C の 個 数 を 低 狭 で きる。

等の効果がある。

又、被品シャッターの透過光の被形は直接駆動と同等の為、 1 d o t 出き込み時間を長くとれ、シャッター開時の透過光の光エネルギーを大きくする事が出来る。第6図に示した様に D A P よ被品(第2図の液品モード)のシャッ

するためには印加電圧をさらに高くしなければならない。現在、安価に作成できる C H 0 S . I C 、としての耐圧は、高耐圧のものでも 3 0 V 程度である。従って、時分割数を増して I C の個数を少なくしても、明暗比を大きくする ために、特別の高耐圧、すなわち6 0 V ~ 8 0 V の耐圧の I C を使うか、もしくは 画像形成 速度の遅いもの、 画楽密度の低いものとしてのみに応用するかの選択にせまられていた。

又、 第 1 8 図に実験により求めた従来の液晶シャッタアレイ(8 μ m の液晶層)に交番電圧 (万元の)大きさと透過率の関係を示す。 図中、 1 8 1 は被長 4 8 9 n m での透過率を、 1 8 2 は 6 5 5 n m での透過率の変化を示している

この実験結果からもわかるように、液晶層にかかる電圧 V Lc が、 及被長 (赤側) の 照明 を用いたときで 2 0 V 以下、 短被長 (青側) での 照明を用いたときで 3 0 V 以下にすると 急激に透過率が増大してしまう。

ターを開にした場合、その光は徐々に通過する。第 6 図の様に通過光の被形は、三角形の形状になる。透過光の光エネルギーは面積 A であり、例えば時間が倍になれば光エネルギーは倍以上にすることができる。

従って、コントラスト比(明部光エネルギー (面積 A) /暗部光エネルギー(面積 B))も 飛躍的に大きくとれる。

今、光数の発光中心被長を540nmとし、 頻素密度16 dot/mm,プロセススピード50 mm/sec とした時、2時分割駆動を行なった場合、3倍以下であったが直接駆動を行なった場合6.5倍程度にひき上げることが可能であ

4. 図面の簡単な説明

第1図は、ゲート絶縁膜とムVthの関係を示す説明図である。

第 2 図は、木発明で用いる液晶素子の断面図 である。

- 第3図(A)は、本発明のTFTを用いた液

晶素子の断面図で、第3図(B)は、本発明の 別の粧晶素子の断面図である。

第4図(A)は、木発明の被晶シャッタアレ 等価 1の透過回路を示す説明図である。

第4図(B)は、本発明の液晶シャッタアレイの平面図で、第4図(C)は、そのA-A′ 断面図である。

第 5 図は、本発明で用いるプリンタヘッド部の斜視図である。

第6図は、本発明の液晶シャッタアレイに印加する駆動信号のタイムチャートを装わす説明図である。

第7回は、本発明の液晶シャッタアレイによるドット作成の際のシーケンスを表わす説明図である。

第8図は、シャッタオン状態時の時系列に於 ける光透過率の変化を表わす説明図である。

第 9 図 , 第 1 0 図及び第 1 1 図は、 鄭動信号のタイムチャートの別の具体例を表わす説明図である。

3 0 4 ; ドレイン唯模

307;セグメント電極

3 1 2 ; コモン電極

3 1 4 ; 遮光膜

3 1 0 , 3 1 5 ; 配向制御膜

3 1 3 ; 被品

401 (4011, 4012, ...)

; TFT

402(4021,4022,...)

:ゲート線

403 (4031,4032,...)

・; データ線

404(4041,4042,...)

;セグメント電板

W 1 , W 2 , W 3 ,

; マイクロシャッタ部

4 0 5 ; 湖走査線

406 : コンタクトホール

57 : プリンタヘッド部

53,1504:被品シャッタアレイ

第12回は、本免明の液晶シャッタアレイの 等価 透過回路の別の具体例を表わす説明図である。

第 1 3 図及び第 1 4 図は、本発明の液晶シャックアレイに印加する駆動信号のタイムチャートの別の具体例を表わす説明図である。

第 1 5 図は、本発明の画像形成装置を模式的に表わす説明図である。

第16回は、従来の液晶シャッタアレイの電 板構造を表わす平面図である。

第17図は、従来の被晶シャッタアレイに印加していた駆動被形を表わすタイムチャートの 説明図である。

第18回は、従来の液晶シャッタアレイに於ける電圧と光透過率の関係を表わす説明図であ

3 0 2 ; ゲート電極

306;ゲート絶縁段

3 0 5 : 半導体膜

3 0 3 ; ソース (データ) 電板

5 1 , 1 5 0 1 ; 感光ドラム

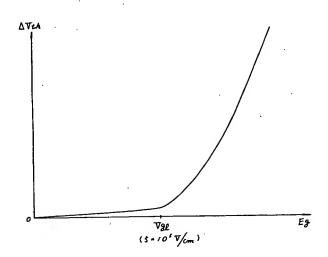
54,1505;光源

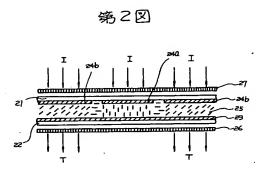
52,1513; レンズアレイ

特許出願人 キヤノン株式会社

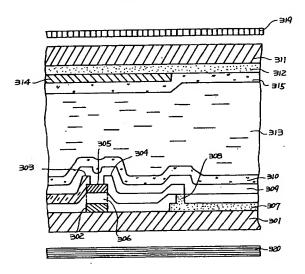
化 理 人 升理士 丸島儀一

第 1 図

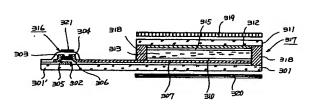




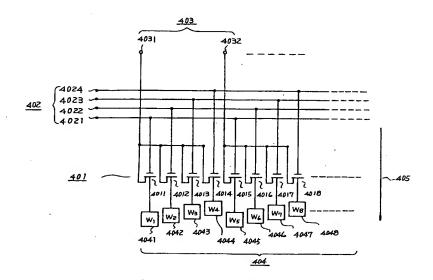
第3図 (A)



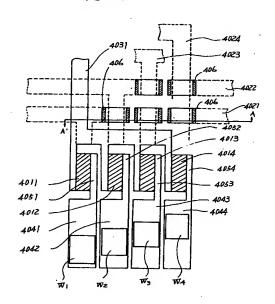
第3図(B)



第4図(A)

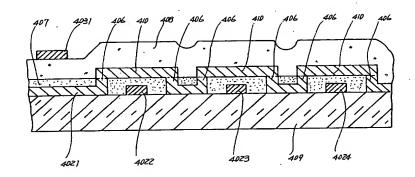


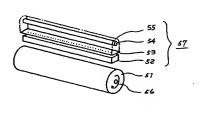
第4図(B)

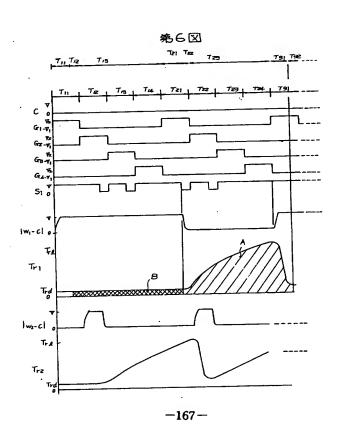


第4図(c)

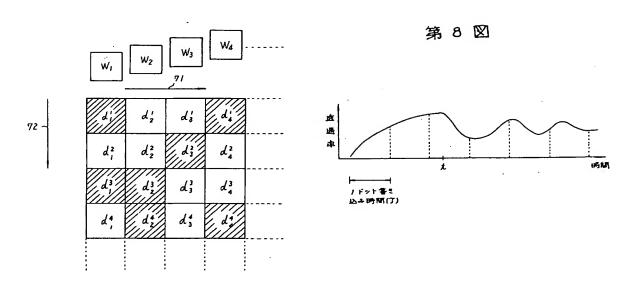
第5図

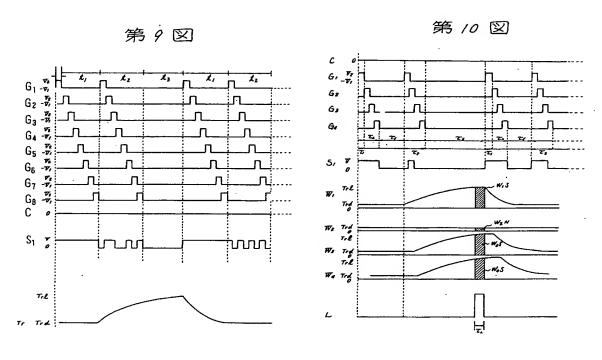


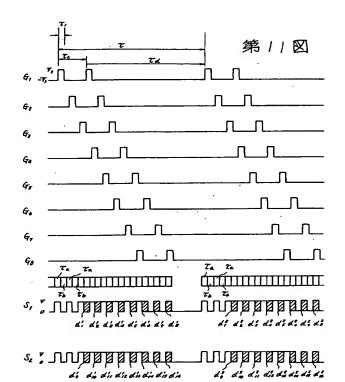


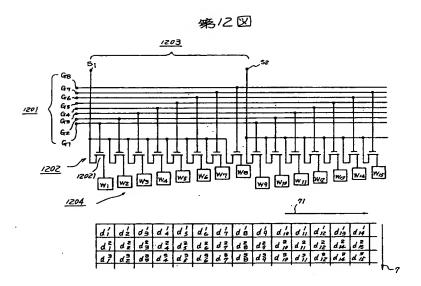


第7図

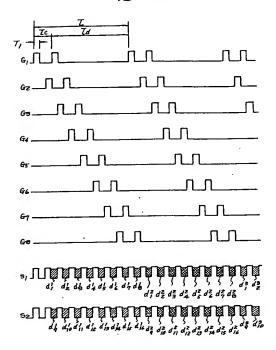




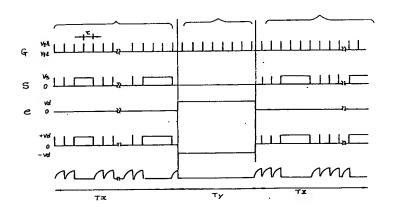








第/4図



第15 図

